

**SEMINAR:
Ellipsometrie und Reflektometrie zur
Qualitätskontrolle dünner Schichten**am Dienstag, den 06. November 2018
in Berlin-Adlershof**Veranstalter:**
SENTECH Gesellschaft für Sensortechnik mbH
Konrad-Zuse-Bogen 13, 82152 Krailling**Veranstaltungsort:**
SENTECH Instruments GmbH
Schwarzschildstr. 2, 12489 Berlin-Adlershof**Seminarprogramm**

- 9:00** **Begrüßung / Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailling
- 9:15 **SpectraRay, SENTECH Software zur Dünnschichtmesstechnik**
Adrian Blümich, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 9:45 **Ellipsometrie mit Flüssigkeitsmesszellen für Proteinmessungen**
Jörg Opitz, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden
- 10:15 **SENDURO MEMS, Dünnschichtmesstechnik in der Fertigung**
Uwe Richter, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 10:45** **Kaffeepause und Diskussion**
- 11:00 **Metrologische Aspekte der Scatterometrie und Müller-Ellipsometrie für dimensionale Schicht- und Strukturcharakterisierungen**
Bernd Bodermann, Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig
- 11:30 **Materialcharakterisierung mittels spektraler Ellipsometrie für hochpräzise ionenstrahlgesputterte Beschichtungen**
Valentin Wittwer, Universität Neuchâtel, Institut für Physik, Neuchâtel, Schweiz
- 12:00** **Mittagessen und Diskussion**
- 13:00 **SENDIRA und Bestimmung optischer Konstanten mit der Infrarot Ellipsometrie für Infrarot Bauelemente**
Sven Peters, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 13:30 **Spektroskopische Ellipsometrie an Gold/Elastomer-Nanostrukturen für dielektrische Elastomer-Sensoren**
Tino Töpfer, Universität Basel, Biomaterials Science Center, Biomedizinische Technik, Basel, Schweiz
- 14:00 **Charakterisierung großflächiger beschichteter Glassubstrate und Folien mit dem SenSol H und SenSol Roll-to-Roll**
Georg Dittmar, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 14:30** **Kaffeepause und Diskussion**
- 14:45 **Closed-cycle Kryostaten bei Tieftemperatur-Analysen mit dem SENresearch**
Matthias Rössle, Universität Potsdam, Institut für Physik und Astronomie, Potsdam
- 15:15 **Optimierung von ALD Prozessen mittels In-Situ Ellipsometrie**
Irina Kärkkänen, SENTECH Instruments GmbH, Berlin
- 15:45 **Alle Teilnehmer des Seminars
sind zum Besuch der Applikationslabore bei SENTECH Instruments eingeladen**
- Ende des Seminars**